

量子コンピュータ研究センター特定共用設備の外部共用について

令和3年6月

理化学研究所量子コンピュータ研究センター
センター長 中村泰信

量子コンピュータ研究センター（以下「センター」という。）では、科学技術に関する試験、研究及び開発を行う方のために特定共用設備の外部共用を行っておりますのでご案内いたします。

1. 特定共用設備の外部共用について

- (1) センターは超伝導量子コンピュータを研究するための様々な設備を所有しています。このような設備の一部を特定共用設備とし、センター以外の超伝導量子コンピュータに関する研究開発を行う方々に使用していただき、若手研究者をはじめとした研究力の向上と産業競争力の強化に貢献します。
- (2) 特定共用設備の使用にあたりましてはセンターと使用者の間で共同研究契約を締結させていただきます。特定共用設備の使用に必要な消耗品等の使用に伴う経費その他の必要な事項については共同研究契約で定めます。
- (3) 外部の使用に当たって、特定共用設備の運転操作は原則としてセンター職員が行います。安全性や設備の保全に問題がない場合には、使用者が自ら、若しくは専門の業者に委託するなどして行うこととします（運転方法や使用に当たっての留意事項などの説明については、センター職員が行います）。

2. 特定共用設備について

センターの特定共用設備は以下のとおりです。

- (1) 基板接合装置 Bondtech 社製 WAP-1000R
- (2) 基板洗浄装置 株式会社カナメックス社製 KC-150CBU
- (3) 共振回路用超伝導薄膜形成装置 エイコー社製 EM5CS-6S
- (4) 無冷媒希釈冷凍機 Bluefors 社製 XLD1000
- (5) 電子線描画装置 Raith 社製 EBP65150
- (6) 電子線レジスト塗布装置 SUSS 社製 RCD8/HP8TT/SD12

3. お問い合わせ

センター長室

E-mail rqc_info [at] ml.riken.jp

※[at]は@に置き換えてください。